This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) COOLING DEVICE FOR ELECTRONIC ELEMENT BODY

(11) 63-254754 (A) (43) 21-10.1988 (19) JP

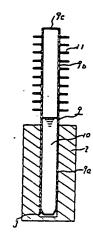
(21) Appl. No. 62-89091 (22) 104.1987

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) HISAAKI YAMAKAGE(1)

(51) Int. Cl. H01L23/46, H05K7/20

PURPOSE: To improve a cooling characteristic, by expanding a heat pipe, inserting the heat pipe, closely attaching the pipe to the side wall of a hole with a bottom in a metal block as a unitary body, absorbing heat, which is yielded in an electronic element body, with the heat receiving part of the heat pipe through the metal block, sending the heat to the heat sink part of the heat pipe, and radiating the heat to the outside.

CONSTITUTION: The opening end of a heat receiving part 9a of a heat pipe 9 is made to face the bottom surface of a hole 3 with the bottom. The heat pipe is expanded. The heat receiving part 9a is inserted and closely attached to the wall surface of the hole 3 with the bottom. A heat sink part 9b is extended from the heat receiving part 9a and arranged in the vicinity of the metal block 2. The open end of the heat sink part 9b is sealed with a sealing piece 9c. The heat pipe is filled with evaporating hydraulic fluid 10 by a specified amount. Fins 11 are attached to the heat sink part 9b of the heat pipe 9. Thus, the adhesion between the heat receiving part 9a of the heat pipe 9 and the metal block 2 becomes excellent, thermal resistance between two parts is remarkably decreased and the cooling characteristic becomes remarkably excellent.



(54) MANUFACTURE OF COOLING DEVICE FOR ELECTRONIC ELEMENT

(11) 63-254755 (A) (43) 21.10.1988 (19) JP

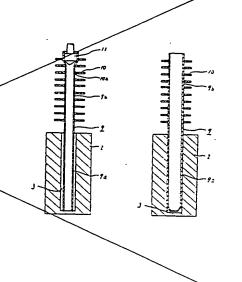
(21) Appl. No. 62-89092 (22) 10.4.1987

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) HISAAKI YAMAKAGE(1)

(51) Int. Cl⁴. H01L23/46,H05K7/20

PURPOSE: To improve a cooling characteristic, by expanding a heat pipe, and closely attaching the material of the heat pipe with a metal block as a unitary body.

CONSTITUTION: A hole 3 is formed in a metal block 2. One side 9a of a heat pipe material 9, whose diameter is smaller than the diameter of the hole 3, is inserted into the hole 3. A plurality of cooling fins 10 are provided on another side 9b of the heat pipe material 9. The fin 10 has a hole 10a, whose diameter is larger than the diameter of the heat pipe material 9 and is the same as or smaller than the diameter of the hole 3 of the metal block 2. Then the heat pipe material 9 is expanded. A pipe expanding tool 11 is inserted into the end part of the other side 9b of the heat pipe material 9b. The tool 11 is made to advance so as to expand the heat pipe material 9 toward the side 9a with compressing force. When the other side 9b of the heat pipe material 9 is expanded, the cooling fins 10 are also expanded. The coupling force between the other side 9b of the heat pipe material 9 and the cooling fins 10 becomes high, and adhesion between both parts becomes remarkably excellent, while the thermal resistance between both parts is remarkably decreased.



(54) MANUFACTURE OF LEAD FRAME

(11) 63-254756 (A) (43) 21.10.1988 (19) JP

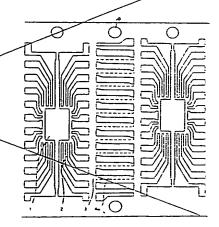
(21) Appl. No. 62-88647 (22) 13.4.1987

(71) NEW JAPAN RADIO CO LTD (72) TAKASHI NAGATE

(51) Int. Cl⁴. H01L23/50

PURPOSE: To make it possible to adopt an interdigitated structure under the state wherein commonness in sizes of pitches is kept even if the pitch is narrow, by forming a frame comprising a pattern having an intermediate shape, and cutting the pattern having the intermediate shape at an outer lead part by laser beam machining.

CONSTITUTION: A die island 1, inner leads 2, a dam bar 3, guide holes 5 and the like other than outer lead parts comprise a final pattern by stamping machining or etching machining. Two outer leads, which are linked to the dam bar 3, to which the outer lead parts correspond, form a unitary body, and a pattern 4a is provided. A frame comprising the pattern 4a is formed. The guide holes 5 are used as references for positioning. The pattern 4a is cut along a broken line and separated into individual outer leads. The cutting can be performed by the laser beam machining at an interval of 0.05-0.1 mm. Therefore, an interdigitated structure can be adopted for the lead frame of an integrated vircuit having, e.g., a 22-pin DIP having a pitch of 1.778.



⑲日本国特許庁(JP)

⑪特許出題公開

四公開特許公報(A)

昭63-254754

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)10月21日

H 01 L 23/46 H 05 K 7/20 B-6835-5F R-7373-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

9発明の名称 電子素子体の冷却装置

②特 願 昭62-89091

塑出 願 昭62(1987)4月10日

砂発 明 者 山 蔭 久 明

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号 三菱電機株

式会社神戸製作所内

切発明者 片岡 憲

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号 三菱電機株

式会社神戸製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

②代理人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 細 🗼

1. 発明の名称

電子素子体の冷却装置

2. 特許請求の範囲

(2)ヒートパイプの放熱配は受熱部の径より大きい径に構成されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子案子体の冷却装置。

(3) 電子業子体が接着され且つ上記電子業子体の ヒートシンクになると共に質道穴が形成された金

(4) ヒートパイプの放熱部は受熱部の径より大きい径に存成されたことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の電子素子体の冷却装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は半導体業子等の電子業子体の冷却装 酸に関し、特にその冷却構造に関するものである。 { 従来の技術 }

第 5 図 5 よび第 6 図は、例えば特朗昭 61 ~ 113265 号公報に示されたこの確复度の従来の概 取を示すもので第 5 図は正面断面図、第 6 図は側

面断面図である。てれら各図において、山は例え ばサイリスタ、トランジスタなどの半導体業子等 の電子素子体(以下、半導体素子と称す)、(1A) および (1B)は半導体素子(1)の端子部、(2)はこれら 端子邸に密接して設けられた金属プロックであり、 半導体業子(1)の発熱を導出するヒートシンクとな り、例えば銅等の熱伝導性の良い金属で構成され ている。(3)は金属プロック(2)に形成された底付穴 であり、複数個形成されている。(4)は半導体素子 (1) の発熱を外部へ導くためのヒートパイプ装置で あり、両端開口が密閉されたパイプ(4A)の内部に 例えばフロン、アンモニア、水等の作動液体(5)が 封入されている。尚、作動液体(5)は常時はパイプ (4A)の一端側(4B)に位置するようにされ、この一 端側(4B)が金属プロック(2)の底付穴(3)に挿入され ている。この場合、パイプ(4A)の外径は上記底付 穴(3)の内径に近い大きさとされていることはいう までもない。又、パイプ(4A)の他端側(4C)には放 熱用の冷却フィン(6)が設けられている。(7)は各ヒ - ト パ ィ プ (4) の 他 端 側 (4C)を 覆 う よ う に 設 け ら れ

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら上述した従来装置では、金属プロック(2)の底付穴(3)の径をバイブ(4A)の外径と完全に一致させることができず、底付穴(3)の径の方が大きくされているため、両者間に空気層が生じる。しかるにこの空気層は無伝達率が悪いため半導を与えているため、素子(1)の冷却特性に著しく悪影響を与えていめに、素子(1)の冷却特性に著しく悪影響を与えているに、低付穴(3)の壁面とバイブ(4A)の一端側(4B)との間に半田等の熱伝導率の良い部材を流し込むことに、出みられたが、バイブ(4A)の一端側(4B)の全面に半田が付着したかどうかのチェックが難しく実用的ではなかつた。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたものであり、冷却特性の優れた電子素 子体の冷却装置を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る電子素子体の冷却装置は、電子 業子体が装者され且つ電子業子体のヒートシンク になると共に底付穴が形成された金属プロック、 た風扇、®はこの風扇(7)に冷風を供給するファンである。

次に動作について説明する。半導体素子(1)によ つて発生された熟は金属プロツク(2)に伝達され、 運に底付穴(3)の壁面を発てヒートパイプ(4)の一端 側 (4B)に伝達され、その内部に封入されている作 動放体(5)に伝達される。この結果、作動液体(5)は 沸 麗 あるい は 蕪 発 して 気 化 し、 ヒート パイプ (4) の 他端側 (4C)に移動する。他端側 (4C)においては、 ファン(8)からの冷却風によつてその壁面が冷却さ れているため、一端側(4B)から移動してきた作動 液体(5)の蒸気が他端倒(4C)の壁面で熱交換するこ とにより凝縮液化し、ピイプ(4A)の壁面に沿つて 再び一端側(4b)に登流する。このような作動液体 (5)の蒸発、液化作用の殺り返しにより半導体素子 (1) の発生熱を速やかに奪い外部に放熱し、半導体 業子(1)の冷却を行うようにしている。尚、ヒート パイプ(4)の他端側(4C)の冷却はファン(8)によるタ イプを示したが、これは自然対流あるいは輻射に よる冷却であつてもよい。

この金属ブロックの底付穴に受熱部の開口端が底付穴の底面に相対すると共に拡管により受熱部が底付穴の壁面と一体密着されて挿着され、放熱部が受熱部から延在して金属ブロック近傍に配設され、内部に蒸発性を有する作動液体を所定量封入されたヒートパイプ、このヒートパイプの放熱部に装着された冷却フィンとを備えたものである。 [作用]

この発明における冷却装置は、金属ブロックの 底付穴の壁面に拡管して一体密着させて挿着した ヒートパイプの受熱部で電子業子体で発生した熱 を金属ブロックを介して吸収してヒートパイプの 放熟部に輸送し外部に放熟する。

〔実施例〕

以下、この発明の一実施例を第1図に基づいて 説明する。第1図において、(2)は金属ブロック、 (3)は底付穴、(9)はヒートパイプであり、金属ブロック(2)の底付穴(3)に受熱部(92)の開口端が底付穴 (3)の底面に相対すると共に拡管により受熱部(92 が底付穴(3)の壁面と一体密君されて揮君され、並 熱部 (9b)が受熱部 (9b)から延在して金属プロック (2) 近傍に配設され、放熱部 (9b) の開口端を封止片 (9c)で封止すると共に内部に蒸発性を有する作動 液体 (0) を所定量封入されている。 即はヒートバイプ (9) の放熱部 (9b) に装着されたフィンである。

発となり熱輸送能力が増大する。即ち、半導体素子(1)の冷却特性をさらに向上ざせることができる。また、第3凶、第4凶にそれぞれ示すように、金属ブロック(2)に形成する穴を貫通穴(3)とし、その貫通端に位置するヒートパイプ(9)の受熱配(9a)の朗口端を封止片(9d)により封止することによってヒートパイプ(9)を構成するようにしてもよく、

上記実施例と同様の効果が期待できる。

〔発明の効果〕

限を受ける不具合を生じる。しかし、この発明に よれば、両者間を完全に否着させることができる ので、熱抵抗を無くすことができるといって過ぎ ではない。この状態でヒートパイプ(9)の放熱部 (9b)の開口端を封止片 (9c)にて封止すると共にそ の内邸に蒸発性を有する例えばフロン、アンモニ ア、 水等の作動液体皿を所定量封入すると、ヒー トパイプ(9)を構成することができる。このヒート パイプ(9)はその結合邸での熱抵抗が無いので、熟 効率が向上することになり、冷却特性の非常に優 れたものとなる。その結果、金属プロック(2)の底 付穴(3)の壁面とヒートパイプ(9)の受熱邸(92)の外 表面との間に空気層が生じることがなく、金属ブ ロック(2)からヒートパイプ(9)の受熱部(9a)への熱 伝達率が著しく向上し、半導体素子(1)の冷却特性 を著しく向上させることができる。

また、第2図に示すようにヒートパイプ(9)の放 熱部(9b)の径を受熱部(9a)の径より大きく構成することにより、ヒートパイプ(9)内面の作動液体00の凝縮現象が活

好なものとなり、両者間の熟抵抗を著しく低減でき、冷却特性の非常に受れたものとなり、電子業子体の熱を選やかに奪い効率よく冷却できる高信頼性の冷却装置を得ることができる。

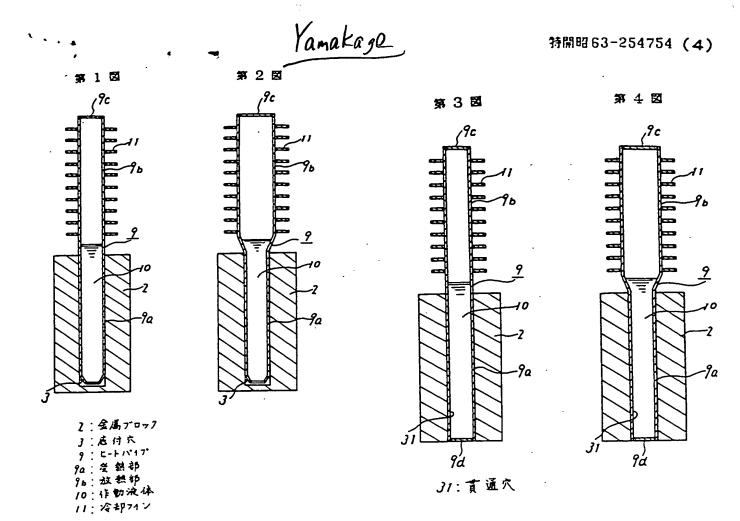
4. 図面の簡単な説明

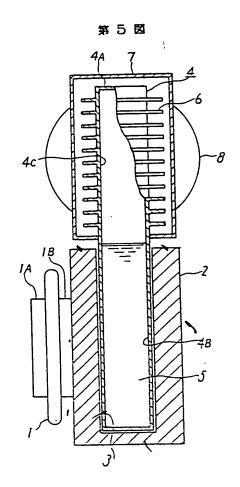
第1凶はこの発明の一実施例による電子案子体の冷却装置を示す要部正面断面凶、第2凶はこの発明の他の実施例を示す要部正面断面凶、第3凶は別の発明の一実施例を示す要部正面断面凶、第4凶は別の発明の他の実施例を示す要部正面断面凶、第4凶は別の発明の他の実施例を示す要部正面断面凶である。第5凶、第6凶は従来の電子案子体の冷却装置を示す正面断面凶、側面断面凶である。

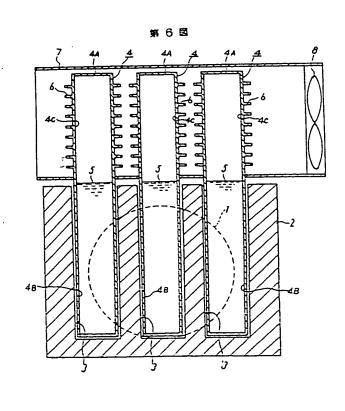
図において、(2)は金嶌ブロック、(3)は底付穴、(9)はヒートパイプ、(92)は受熱部、(9b)は放熱部、(u)は作動液体、(II)は冷却フイン、(II)は質迪穴である。

尚、凶中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代型人 大岩增 雄







31: 黄通穴